6. ガラス・セラミックス試料の簡易不純物定量法 Simple Impurity Determination for Glass and Ceramics

竹中敦義* Atsuyoshi Takenaka

ICP-AES is widely applied for the elemental analysis of glass and ceramics. However, such application might be impossible because of the difficulty in sample decomposition, and evaporation and/or precipitation of the objective elements when the sample is prepared in solution. XRF is capable for the elemental analysis in solid or powder states while the standard preparation is sometimes difficult for calibration. In this paper, we have investigated the simple technique of standard preparation for XRF measurements. Standard solution containing known amount the objective elements is added to a sample powder, then dried and mixed. The calculation of detection depth for X-ray implies that the standard preparation technique developed here could be applied for the elements heavier than Na if the particle size is less than $1 - 2 \mu$ m. The detection limits of Na - Bi are 0.1 - 10 ppm in SiO₂ matrix.

1.緒 言

ガラス、セラミックス材料中の不純物元素は材料 特性や製品の信頼性に影響を与え、また環境問題の 観点からも定量が必要になることが多い。通常は化 学分析で酸分解などにより溶液化してから元素分析 装置(ICP発光法、ICP-MS法、原子吸光法、イオンク ロマトグラフィなど)で測定を行うが、組成によっ ては 分解が困難、 分解時に揮散、 不純物元素 と主成分が難溶性塩になるなどのため溶液化が困難 な場合がある。濃度既知の標準があれば分解せずに 固体のまま元素分析装置(蛍光X線法、SIMS法、 GD-AES法、GD-MS法など)で定量できるが、市販 されている標準試料が利用できない場合は、自分で 調達・調製しなければならない。この場合、化学分 析が困難な試料を一度は化学分析しないといけない 矛盾が生じる。この矛盾を避けるため粉末標準添加 法とバルク固体の分析法である蛍光X線法と組み合 わせる検討を行った。このような例はセメント中の CIを測定するためにNaCI溶液を添加・乾燥した例は あるがい、ガラス、セラミックス試料における例は 見当たらない。検討の結果、簡便にppmオーダーの 微量不純物を定量できる手法を確立し、ガラスマト

リックス中の数十種類の元素の検出下限を測定した ので報告する。

- 2.装置、試薬
- 2.1 装 置
 本研究で使用した装置を以下に示す。
 蛍光X線分析装置
 RIX3000(リガク社製) Rh管球(3.0kW)/Cr管
 球(2.4kW)デュアルタイプ
 ZSX100e(リガク社製) Rh管球(4.0kW)

2.2 試 薬
本研究で使用した試薬を以下に示す。
原子吸光用標準液(Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Ba, Ce, W, Pt, Pb, Bi)
イオンクロマトグラフ用標準液(SO4²⁺、PO4³⁺、F⁺、Cl⁺、Br⁺)
特級硝酸、純水(蒸留 イオン交換水)

^{*}Research Center

3. 実験操作

ガラス、セラミックス試料をアルミナ乳鉢で粗粉 砕した後に、メノウ乳鉢を用いて微粉砕する。その 際に湿式粉砕のほうがより微細化できるが、試料成 分が水・アルコールと反応もしくは溶出しやすいと きは乾式で行うのが望ましい。ガラスフリットは製 品自体が粉末なのでそのまま用いる。

ポリビーカー3個を洗剤で洗浄した後純水でよく 濯ぎ、添加する元素の原子吸光用標準液(1000ppm) を 0ml、 0.5ml、 1.0ml添加し、0.1N-HNO₃: 5ml、エタノール:1mlを加えて混合した後、試料粉 末10gを加えて混ぜる(ハロゲン元素を添加する場 合には0.1N-HNO₃に替えて10mN-NaOHを用いる)。 ウォーターバス上で蒸発乾固し、乾固物をメノウ乳 鉢で再粉砕しPTFE棒で全体をよく混合した後、プ レス成型して蛍光X線用の測定試料とする。この操 作で測定元素を Oppm、 50ppm、 100ppm標準 添加した標準系列を得ることができる。標準添加濃 度を変更する場合は、原子吸光用標準液原液または 適宜希釈した標準液を用いて、下記の式から添加液 量を算出する。

(標準添加濃度ppm)

=(標準液濃度ppm)×(添加液量ml)÷(試料重量g)

4.結果と考察

4.1 粉末標準添加法の考え方

化学分析(溶液系)では元素分析装置で定量する 際に、試料溶液の共存元素(マトリックス)を無視 して測定元素だけの標準溶液で検量線を作ると分析 値に誤差が生じることがある。標準液に共存元素の 各成分濃度が一致するように添加することでその影 響を補正できるが、試料によって共存元素の組成、 濃度が微妙に異なる場合、共存元素濃度を定量して から標準を作る作業を試料毎に行うのは極めて煩雑 である。その場合は、試料を3~4個に小分けして 測定元素を一定量ずつ添加する標準添加法を用い る。たとえば 添加無し、 10µg添加、 20 u a添 30µg添加してからそれぞれを一定体積に定 加、 容すると、マトリックスが完全に一致した標準系列 を得ることができる。これらから作成した検量線の 傾きはマトリックスの影響を反映しているので、添 加無しの試料の信号強度を濃度に換算するとマト リックス誤差が補正された分析値を得ることができ る。試料溶液に測定元素を添加した際、試料由来の 不純物元素と添加した標準元素は完全に均一に混ざ るため精度と再現性が確保できるのが溶液系の標準 添加法の考え方である。

ガラス・セラミックスに対して標準添加法を適用 する場合、原料調合に標準元素を添加しても溶融・ 焼成の際に濃度変化が起こり、最終生成物中の濃度 は化学分析しないと確定できない。これに対して試 料粉末に測定元素を含む標準液を滴下し乾燥・混合 すると試料に対して任意の一定量の標準元素を添加 することができる。しかしこの場合、添加元素は試 料粒子表面に付着するか、それ自体が微粒子となっ て混在することになり、溶液系のような完全な均一 系にはならない点が問題として残る。

試料粉末を蛍光X線法で測定する場合、測定元素 の特性X線が試料粉末粒子を通過する際に減衰を受 け、共存元素によってその減衰率が影響を受ける。 試料粉末の内部に測定元素が均一に存在している場 合は、X線の減衰は指数関数曲線を描くが、試料粉 末と標準添加元素が不均一に混在している場合は、 不規則な階段状の減衰曲線となる。しかし、粉末粒 子が十分に細かいか、粒子径に比べて測定深さが十 分に深ければ、相対的に階段状のピッチが狭くなり 指数関数曲線に漸近していくので、均一系と同等に 扱えると考えられる。

粒度に関してはガラス・セラミックス試料をメノ ウ乳鉢で丁寧に粉砕すると1~2µm程度の粒度に なり、ボールミルなどの粉砕機(湿式)を使用する と1µm以下の微粒子を得ることができる。しかし 粉砕に時間をかけると粉砕器材からの汚染が増える ので、あらかじめ測定元素が混入しないか確認が必 要である。

測定深さは軽元素と重元素で大きく異なり、0.1~ 数百µmもの開きがある。また特性X線にはK線、L 線、M線と種類があり、同じ元素でも用いる特性X 線のエネルギー(波長)によって測定深さは変わっ てくる。できるだけ測定深さが大きい特性X線を選 ぶことが望ましく、通常B~CsはK線で、Ba~BidL 線で測定するが、Ru~CsはL線で測定するほうが S/B比が優れることもある。測定深さが20~30µm 以上あれば粒子径が1~2µm程度でも相対的に均 一系と見なせると考えられ、粒子径が1µm以下で あれば測定深さが20~30µm弱の元素でも対応でき ると考えられる。各元素における測定深さについて は次節で詳細に検討する。

4.2 測定深さ

測定元素から発生した特性X線は他の物質を通過 する際に強度が減衰する。

- その減衰は指数関数曲線を描き、下式で表される²。 l(t)=l₀exp(-µt)
 - I(I)= I₀ exp(μ I)
 - t:通過する物質の厚さ
 - µ:通過する物質の減衰係数
 - l。:入射X線強度
 - I(t): 厚さtの物質を通過した後のX線強度

ここで入射X線強度がちょうど半分になる厚さを 半減厚Dとすると減衰曲線は以下のように書きなお すことができる。

 $I(t) = I_0(1/2)^{t/D}$

このように物質の減衰係数は半減厚に含まれ、物 質の厚さを半減厚の何倍かに換算すると減衰後の強 度が見積もりやすくなり、減衰挙動の検討には半減 厚を用いた方が簡便でわかりやすい。たとえばt/D =7のときは(1/2)⁷ = 1/128、t/D = 10のときは (1/2)¹⁰ = 1/1024となり、約百分の一、約千分の一に 減衰する。

測定元素を含む均一な物質からの特性X線強度は、 深さtからの減衰を受けたX線強度の積分になるの で、厚さtの物質の総X線強度 C(t)は下式のよう になる。

 $Q(t) = \int_{0}^{t} I_{0} \exp(-\mu t) dt$

 $= C \{ 1 - exp(-\mu t) \}$

 $= C \{ 1 - (1/2)^{t/D} \}$

ここでC は物質厚さが十分に大きくて強度が飽和したときの無限厚強度である。t/D = 7のときは無限厚強度に対して99.2%、t/D = 10のときは99.9%になるので、半減厚の10倍(実質的には7~8倍)以上あれば測定強度は無限厚強度とほぼ同等になり、それ以上の厚みはあってもなくても測定強度に影響が無い。すなわち半減厚の10倍の深さが測定強度に影響を与える測定深さとなる。よって測定対象元素の測定深さは次のように簡便に表すことができる。

測定深さ=(マトリックス物質中の半減厚)×10

半減厚を求めるにはマトリックス物質の減衰係数 が必要であるが、マトリックス物質が多成分系の場 合は下式のような計算が必要になり、さらに減衰係 数は特性X線の波長 (またはエネルギーE)の関数 になるので、元素ごとの基本定数(ファンダメンタ ル・パラメーター:FP)の詳細な一覧表と特殊な計 算ソフトが必要となる。

 $(\mu())^{-1} = (Ci/\mu i())$

(Ci: 成分iの濃度、µ(): 成分iの減衰係数) 蛍光X線装置(リガク製)のデータベースには詳 細なFPが格納されており、計算ソフトである「オフ ライン定量」または「シミュレーション」を用いると 多成分系マトリックスにおける任意の特性X線に対 する半減厚を簡便に求めることができる。

特性X線のK線シリーズに対する半減厚を計算で 求めた例をFig.1に示す。マトリックス物質として 合成石英ガラス、ソーダライムガラス、無アルカリ ガラスを用いた。主成分であるSi、Oの少し高いエネ ルギー領域でSi、Oの吸収による半減厚の大きな低下 が見られ、AS、ANではSi、O以外の成分元素(Na、 Mg、AI、Caなど)付近でも半減厚の低下が見られ る。ASはAI, Na, Mg, K, Caと比較的軽い元素が主成 分なので、半減厚の低下は小さく合成石英ガラスと ほぼ同等であるが、Sr, Baなどの重元素を多く含む ANガラスでは半減厚が全体的に小さくなっている。

半減厚の10倍を測定深さとすると、石英ガラスマ トリックスでNaは約5µm、S、CIで10~15µm、Fe で約20µm、Cuで約40µmとなる。ANガラスでは Fe付近から上のエネルギー領域で石英ガラスとの乖 離が大きくなり、Feで1/2弱、Asで1/3、Rhで1/4弱、 Ceで1/6になる。Sr、Pb、Biなどを含むフリットガ



Fig. 1 Thickness at half maximum in glasses by FP calculation.

ラスやファンネルガラスはX線の透過率が極めて低く、半減厚は数十分の一になると予想される。

特性X線のL線シリーズに関しては横軸のエネル ギーからグラフを読み取ればおおよその半減厚を見 積もることができる。

測定深さが大きいほど測定に関わる原子数が増え るので感度の向上が期待できる。しかし、測定深さ が大きい=励起エネルギーが高いことになり、1次X 線で十分に励起できずに感度低下が起きるため、横 軸にエネルギー(原子番号)、縦軸に検出下限を取 るとU字型になると推定される。検出感度の詳細に ついては次節で述べる。

4.3 検出感度

ガラスにおける各元素の検出下限を評価するため に、理想的な系として合成石英ガラスをマトリック スとした場合の検出下限を測定した。測定条件は以 下の通りである。

装置:RIX3000(リガク社製)
管球:Rh(50kV-50mA)、Cr(40kV-55mA)
分光結晶:TAP(001)・・・Na、Mg
PET(002)・・・Al、Si
Ge(111)・・・P、S、Cl
LiF(200)・・・K~Bi
1次フィルター:Zr、Cu、Ti、AI 適宜使用
測定径:30mm 、測定時間:40秒
測定試料:合成石英ガラスをメノウ乳鉢で粉砕し、
原子吸光用標準液を100ppm分添加し
乾燥後再粉砕しプレス成形して各元素
のX線強度を測定する。未添加試料を
ブランクとして40秒×10回測定し、ブ
ランク値の標準偏差の3倍を濃度換算
したものを検出下限とする。

測定結果のK線シリーズをFig. 2、L線シリーズを Fig. 3に示す。 蛍光X線分析でRh管球が一般に用いられるのは、 Rh-Ka線(20.2keV)が中~重元素を、Rh-La線 (2.7keV)が軽元素をバランスよく励起できるため である。Rh(原子番号45、Fig. 2中*印)より原子 番号がやや小さい元素は最も効率よく励起されるた め1ppm以下の検出下限を持つが、軽元素に向けて 次第に検出下限は悪くなる。またRhより原子番号が 大きい元素に対してはRh-Ka線で励起できず、バッ クグランドの連続X線で励起しているため効率が悪 く検出下限が悪くなる。このようにRh付近を底にし て検出下限はU字型を描くことがわかる。

Rh-La線の少し上の2.7~5keVの領域(Cl-Ka~Cr-Ka)はRh-La線では励起できず、Rh-Ka線からは遠くて励起効率が低い谷間の領域だが、Cr管球を用いると効率よく励起できるためRh管球よりも検出下限が良くなる。Cl-Kaで2.5倍、Ti-Kaでは10倍近く検出下限が改善され、Sn-La~Ba-Laでも10倍近い改善が見られる。









以上より、SiO2のみの理想的なガラスでは検出下 限は0.1~10ppm程度になることがわかる。積算時間 を40秒より長くすると時間の平方根に反比例して検 出下限は下がる。また管球出力を50kV-50mAより高 くするとより検出下限の改善が期待できる。しかし 実際のガラス試料ではSiO2以外の成分が10種類前後 共存して半減厚を低下させ検出下限を悪化させる。 さらに測定元素と原子番号が近い元素がガラスに共 存していると共存成分ピークが重なって測定元素の ピークが検出不能になる可能性もある。また管球由 来の不純物ピークとしてFe、Cr、Ni、Cuが0.5kcps 前後検出されることがあり、それらの微量不純物を 測定する場合は注意が必要である。合成石英ガラス 基板を測定してそのような不純物ピークが出るかど うかあらかじめ確認して、バックグランド強度とし て差し引けば補正になる。

4.4 粉末標準添加法の再現性と正確性

粉末試料に溶液を添加し乾燥させる標準添加法で は、試料粉末と添加した測定元素が均一に混合して いることが前提であるが、それを検証するために実 験を行った。測定深さの浅い元素としてNa(SiO2中 約4µm)、深い元素としてZn(SiO2中約400µm) を選び、5回プレス成型しなおして蛍光X線強度を 測定した結果をTable 1に示す。もともとNaは蛍光 X線強度が弱いためRSD%は高くなりやすいが、 RSD%=3.4から混合時の偏差は小さいといえる。Zn では測定深さが十分に深く、多少の混合の不均一が あっても平均化されてRSD%は小さくなっていると 考えられる。よって十分に注意して試料調製を行え ば試料粉末と標準添加元素の不均一性は無視できる と考えられる。

測定条件...試料:合成石英ガラス、 添加濃度:100ppm、 測定出力:Rh50kV×50mA 積算時間:40秒、 測定径:30mm

また従来法とのクロスチェックとしてフッ酸分 解-ICP発光法で不純物濃度を比較した結果を Table 2に示す。両者には良い一致が見られる。

Table 1 Reproducibility of Samplin	g	J.
------------------------------------	---	----

	Na	Zn	
	0.0292	1.742	
Intensity (kcps)	0.0313	1.780	
	0.0310	1.714	
	0.0297	1.757	
	0.0320	1.763	
Average	0.0306	1.751	
Standard Deviation	0.001037	0.02223	
RSD%	3.4%	1.3%	

(unit:µg/g)	Elements	ICP-OES	XRF	
Colored glass	Colored Co		4	
Flit glass	Fe	7	7	
	Pb	11	11	

 Table 2
 Comparison New Method with Ordinary Method.

4.5 応 用 例

(1)合成石英ガラス中のCI分析

合成石英ガラスはSiCl₄を原料とするため製造条件 によってCIがガラス中に残留することがあり、機械 的特性、光学的特性に大きく影響する。したがって CI量の把握は重要である。蛍光X線(Rh管球)で微 量CIを測定する場合、Rh-La線の裾にCI-Ka線が重な り検出下限が悪化する。粉末標準添加法により検出 下限を見積もるとRh管球では5ppm (DL=3)であ る(粉末標準添加法でCIおよびハロゲン元素を添加 する場合に、添加標準液が酸性だとHCIになって揮 散するためアルカリ性で添加する。)。Cr管球を用い るとCI-Ka線の励起効率が高くなり、Rh-La線の妨害 もないため検出下限が向上する。用いた装置が Rh/Crデュアル管球のためCr励起線にRhのゴースト ピークが微小であるが存在するため、CI測定に若干 妨害を与える。この場合の検出下限は2ppmである。 Rh管球とCr管球のベースラインの違いをFig. 4に示 す。90 ℃近のRh-La線との分離を向上するためFine スリットを用いているが、Rh管球ではまだRh-La線 の裾がCl-Ka線にかかりベースラインが斜めで凹んで いる。Cr管球ではCI-Ka線付近はほぼフラットな ベースラインになっている。また出力がRh管球 (40kV-70mA)に比べてCr管球(40kV-55mA)は約 3/4であるが、蛍光X線強度はほぼ同等であることか らCI-Ka線に対してCr管球の励起効率が高いことが わかる。



Fig. 4 CI-Ka spectra by Rh-tube (red line) and Cr-tube (blue line).

(2)ガラス中Coの分析

ガラスの着色剤であるCoは色調調整のため濃度管 理が必要である。通常ガラス中には1~10ppm程度 の添加であるが、濃色ガラスなどは濃度が高いので

100ppmまでの標準添加系列を作成した。スペクト ルと検量線をFig. 5、Fig. 6に示す。良い直線性を示 し、数ppmから数十ppmの測定に対応が可能である。



Fig. 5 Co-Ka Spectra of Co added glass(Co:0, +10, +20, +50, +100ppm).



Fig. 6 Calibration curve for Co added glass.

(3)ブラウン管用パネルガラス、ファンネルガラス 中の有害元素分析

製品中に有害元素(Cd、Pb、As、Hg、Cr)が規 定濃度(5ppm)以上含有していないことを客先に データ提出するため粉末標準添加法を用いて測定を 行った。Cdは蛍光X線装置のRh管球由来のピーク (Rh-Kb,)がCd-Ka付近にでるため、測定条件は以下 のようにした。分光結晶を分解能の高いLiF(222) を用いたが、標準装備のLiF(220)とFineスリット を用いても同様の測定が可能である。

測定条件…Rh管球50kV×70mA、 1 次フィルター:Zr、 スリット:Coarse(標準) 分光結晶:LiF(222) 測定線:Cd-Ka線、

測定例をFig. 7に示す。Cd-Ka線にRh-Kb₂線がほぼ 重なるため、合成石英ガラス(Cd<1ppb)をブラ ンク試料として測定し、Cd-Ka/Rh-Kb₁強度比を算出 し差し引いてから標準添加補正を行い定量する。定 量結果をTable 3に示す。ソーダライム系ガラスであ ればCr、Cdは1ppm程度の検出下限が予想される。 しかし、パネルガラス、ファンネルガラスはX線阻 止能の高いガラス組成のため検出下限が高くなって いるが、5ppm以下を確保できるように積算時間で 調整した。

Table 3	Measurement	of Cr.	. Cd in	TV	Tube Glass.
---------	-------------	--------	---------	----	-------------

(unit:µg/g)	C	Cr	Cd		
Panel glass	3.0	DL:1.1	<1.7	DL:1.7	
Funnel glass	3.0	DL:1.8	<3.9	DL:3.9	

5.結 言

粉末標準添加法で第三周期以上の元素を蛍光X線 法で定量する方法を確立した。それはガラス・セラ ミックス試料を粉砕して粉末粒度を1~2µmもしく はそれ以下にする。さらに測定元素を含む標準液を 試料粉末に添加し乾燥・再粉砕する方法である。酸 溶解、完全溶液化が困難な試料でも、測定元素と主 成分元素の蛍光X線ピークが重ならなければ数ppm レベルの検出下限で測定が可能である。

- 参考文献 -

(1)リガクアプリケーションレポートXRF139

(2) 蛍光X線分析の手引き(リガク社製非売品)



